

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】令和1年10月10日(2019.10.10)

【公開番号】特開2018-65199(P2018-65199A)

【公開日】平成30年4月26日(2018.4.26)

【年通号数】公開・登録公報2018-016

【出願番号】特願2016-203685(P2016-203685)

【国際特許分類】

B 2 3 Q 17/09 (2006.01)

G 0 5 B 19/18 (2006.01)

【F I】

B 2 3 Q 17/09 A

G 0 5 B 19/18 W

【手続補正書】

【提出日】令和1年8月30日(2019.8.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

次に、サンプリング周期 S_T での主軸2の駆動負荷の測定を開始するとともに、その測定値と測定時における主軸2の回転位相とを関連づけ、測定記録部4へ順次記録する(S2)。なお、制御装置12が、主軸装置11から主軸2の回転位相を取得しない場合には、下記式1にて回転周期 $R_T = 100 \text{ msec}$ と求め、測定開始からの経過時間と回転周期 R_T との剩余によって、主軸2の回転位相を算出するようにしてもよい。

【数1】

$$\text{回転周期 } R_T [\text{sec}] = 1/(R_{spd}/60) \quad \dots \quad \text{式 1}$$